

兼松株式会社

半導体装置部 第1課 第2課

〒105-8005 東京都港区芝浦1-2-1

TEL 03-5440-8475 FAX 03-5440-6550

HP: <http://www.kanematsu.co.jp>

Email : equip@kdc.kanematsu.co.jp

半導体製造装置(前工程)



AP&S



高極薄ウェーハ搬送用治具装着装置



- ◆ ウェーハ厚: 50 μ - 1000 μ m
- ◆ Wafer サイズ: 12"まで対応可能
- ◆ フルオート、セミオート対応可能
- ◆ カプセルは、耐液性、耐熱性に富む(20-90°C)
- ◆ バッチ式カセットへのオートローディング可能



(株)サイエンスアイ



電解/無電解メッキ装置



実験機から量産機まで各種用途のメッキ対応

- ◆ フルオート量産機
 - ・フェースアップ方式
 - ・フェースダウン方式
- ◆ 12"対応
- ◆ Au、Cu、Ni、Ag、Solerメッキ等幅広いラインアップ
- ◆ 各種実験機用メッキ装置



(株)UTKシステム



精密洗浄ブラシ装置・研磨装置

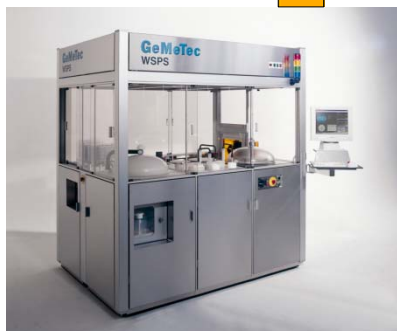


ブラシ・研磨機を用いたトータルソリューション提供

- ◆ 半導体、LCD、ハードディスク製造メーカー向けに豊富な実績
- ◆ 両面研磨装置では独自技術による超薄物ウェーハ加工可能

munich metrology Munich metrology (旧ゲメテック)

 ドイツ



金属汚染検査装置

ウェーハ表面金属元素分析用試料

- ◆ 独Wacker社との共同開発によるデータの蓄積
- ◆ ウェーハエッジ0mmまで走査可能
- ◆ 日本国内、及び米、台湾での実績多数
- ◆ 高い信頼性と使いやすさ

Vector
Semiconductor CO.,LTD.

ベクターセミコン(株)



プロセス評価・不良解析用プローバー

12"対応 微小電流測定用セミオート・プローバー

- ◆ 日本国内で大きな市場シェア
- ◆ ローノイズ・ローリーケージ対応サーモチャック
- ◆ 特殊シールド構造のチャンバー
- ◆ セミオートローダー&アンローダー付き
- ◆ IV/CV測定用ソフトにより自動測定が可能

その他取扱製品：マニュアル・プローバー

半導体プロセス(後工程)

EPSON

セイコーエプソン(株)



ICテストハンドラ

水平搬送式高速ICテストハンドラ

- ◆ 世界中で100社以上2,000台の納入実績
- ◆ 1個測、2個測、4個測、8個測、16個測対応
- ◆ 豊富なオプション
- ◆ Change Over Kitは米国・シンガポールの製作会社による現地対応可能
- ◆ 納期及び品質は最上級、コスト競争力も高い

その他取扱製品 : EPSON製ロボット

MUSASHI
ENGINEERING, INC.

武蔵エンジニアリング(株)



ディスペンサーシステム

微量点塗布用超高速・超高精度ディスペンサー

- ◆ 日本での圧倒的なシェア
- ◆ 米国・東南アジアでの販売・保守サービスあり
- ◆ マニュアル～フルオートシステム迄フルラインナップを取扱
- ◆ 高精度ディスペンス制御に関して、日・米・独・韓で特許取得済

TechWing

TechWing



メモリーハンドラ

高生産性メモリーテストハンドラ

- ◆ 最大480個同時測定可能
- ◆ 世界中の大手テストハウス、IDM向けに多数の出荷実績
- ◆ 容易な操作性
- ◆ 低ジャムレートによる高信頼性



SEMIgear



フラックスレス リフロー装置

(Serial Thermal Processor)

- ◆ 独自の方法により、フラックスの必要なし
- ◆ 全リフロー工程を1台で対応
- ◆ 全てのソルダーバンプに対応
- ◆ 高品質なリフローが可能
- ◆ 高スループット、小スペース、Low COO



NEXX Systems



Stratus 200

WLP、TSV用メッキ装置“STRATUS”

- ◆ 高スループット、優れたCOO
- ◆ あらゆるメッキ液、メッキ材料に対応
- ◆ 完全モジュール構成によりフレキシブルな装置構成が可能
- ◆ 複数ウェハサイズの同時処理を実現



Nimbus 364

多層膜スパッタリング装置“NIMBUS”

- ◆ 全処理を真空中で処理するインラインシステム
- ◆ シンプルな設計で卓越したスループットを実現
- ◆ 高真空中での異種材の連続スパッタが可能
- ◆ 50mm-300mmウェハ全てに対応



Semics



韓国



フルオートプローバー

高性能なフルオートプローバーを低価格にてご提供

- ◆ 対応ウェハサイズ: 6・8・12inch
- ◆ 高位置精度、高インデックスタイム、高耐荷重
- ◆ 世界中の大手テストハウス、IDM向けに多数の出荷実績

Athlete

アスリートFA(株)



各種IC組立装置

高生産性な各種IC組立装置

＜主要製品＞

- ◆ BGAボールマウンター
- ◆ フリップチップ・ボンダー
- ◆ TABポッティング・システム
- ◆ 世界中の大手デバイス・LCDメーカーに多数の出荷実績



イーピーエム



カナダ

メモリテスター

メモリテストシリーズ MS5205

- ◆ 評価解析からプロセスコントロール評価にワールドワイドでの実績あり
 - ◆ 最大16Gbリアルタイムビットマップ
 - ◆ プログラム作成エディター(GSE)による簡易パターン作成
- その他取扱い商品 MS4205EX(高速メモリテストシリーズ)





FTS
USA



温度環境試験装置

高性能温度サイクルシステム

- ◆ 世界中の大手デバイスメーカーに多数の販売実績
- ◆ -80°C ～ $+200^{\circ}\text{C}$ を僅か10秒で変更可能
- ◆ 二元コンプレッサー使用による低メンテナンスコスト
- ◆ 抜群の信頼性・安定性

その他取扱製品： 低価格な卓上型も用意しております



esmo
ドイツ



マニピュレーター

1, 300kgまでのヘッドを支えるマニピュレーター

- ◆ 安定したデザイン
- ◆ 高い安全性
- ◆ 正確なポジションニング
- ◆ モーター駆動によるコントロール
- ◆ 高生産性メモリーテストハンドラ

FPD関連装置



(株)石井表記



PIインクジェット塗布装置

FPD用全自動PI用インクジェット・プリベーク装置

- ◆ 大型ガラス基板対応(G5.5~G9サイズ)
- ◆ 品種切換え容易(多品種対応)
- ◆ PI液の使用効率UP
- ◆ 省スペース軽量化



ワイエイシイ (株)



高密度プラズマエッチング装置

COSMOシリーズ

- ◆ 高密度プラズマ源TCPTM搭載
- ◆ 低圧条件下で幅広いプロセスウィンドウを実現
- ◆ 静電チャック(ESC)の採用でガラス基板の均一な温度制御が可能
- ◆ G5クラスまでの各種基板サイズに対応



KENMEC



台湾



梱包装置/開梱装置

大型基板対応梱包/開梱装置

- ◆ 大型基板対応
- ◆ 大手液晶メーカーへの導入実績あり



レーザーカットシステム

CO2レーザーを用いたレーザーフルカットシステム

- ◆ 各種ガラス基板対応
- ◆ 貼り合わせ基板の一括切断、端子出し加工が可能
- ◆ 切断面強度向上、切断面研磨不要
- ◆ クラック、カレットの発生なし



偏光板貼付装置

大型基板対応偏光板貼付装置

- ◆ 貼付精度 ± 0.3 mm
- ◆ 大型基板対応
- ◆ 大手液晶メーカーへの導入実績あり

その他取扱い商品：偏光板剥離装置
脱泡機オートクレーブ

半導体・FPD 関連装置の技術サービス



(株)パシフィック ウェスタン システムズ・ジャパン



海外装置の技術サービス提供

- ◆ 海外製半導体製造装置の据付、保守、改造等の技術サービス
- ◆ 中古半導体製造装置の販売、仲介、保守サービス立上げ、改造
- ◆ 半導体製造/検査装置の開発、設計、製造、販売